# La formation du signal

# Le principe

•Une particule chargée est ralentie dans le matériau et perd son énergie suivant différents processus (ionisation)

- •Création de paires électron-trou dans le détecteur
- •Séparation des paires sous l'action d'un champ électrique

 Migration des charges vers les électrodes : les électrons -> N, les trous -> P

Collection et formation du signal



<u>-</u>P

# Pourquoi la déplétion !





## La nature du rayonnement

- Les particules chargées, ions lourds, ions légers
- -> pouvoir d'arrêt dE/dx (Bethe-Bloch)
- Il faut adapter les épaisseurs de détecteurs aux parcours des ions (Si)
  - alpha de 5.5 MeV ->~27 μm
  - <sup>208</sup>Pb de 1 GeV -> ~60µm
  - <sup>53</sup>Cr de 747 MeV -> ~180 μm
  - proton de 5 MeV -> ~216µm
  - <sup>208</sup>Pb de 6 GeV -> ~330µm
  - Electron de 975 keV -> ~1.7 mm
  - proton de 30 MeV -> 4.9 mm

# La nature du rayonnement

- Les photons : X,  $\gamma$ 
  - détection indirecte
  - Les effets dépendent du Z du matériau :
    - Absorption photoélectrique,  $SE = cste.Z^{4.5}.E^{-3}$
    - Diffusion Compton,  $SE = cste.Z.E^{-1}$
    - Création de paires, SE varie comme Z<sup>2</sup>

Ge (Z=32) plus efficace que Si (Z=14)

- Les détecteurs sont adaptés aux énergies des X et  $\gamma$ 
  - Si(Li) refroidi pour des X jusqu'à 100 keV
  - Ge pour des  $\gamma$  jusqu'à 10 MeV





# La collection des charges

- Cas le plus simple
- Cas général



### La collection des charges (cas simple)

- le déplacement d'une charge q entre 2 électrodes parallèles distantes de D induit un signal sur ces électrodes dQ = q dx/D
- et dans le circuit extérieur, un courant i = q v/D



- c'est donc le mouvement des charges qui induit un signal plutôt que les charges collectées. (Ramo - 1939)
- Résultat valable en présence de zones de charge d'espace (Cavalleri - 1963)



# Le signal

- Le mouvement des charges induit le signal i = qv/D
- Chaque porteur de charge induit un courant :
  - i = qv/D pour les électrons
  - $i_{+} = qv_{+}/D$  pour les trous
- Le courant total est la somme de toutes les contributions
- En pratique :
  - On exprime le champ électrique en fonction du type de détecteur F(x)
  - On écrit l'équation du mouvement x(t) à partir de  $v=\mu F$
  - On calcule le courant i (†) à partir de Ramo
  - Puis la charge Q(t)
  - On évalue le temps total de collection
- Base des simulations

# Pour une paire électron-trou



### Le signal dû à une paire (formalisme de base)

Signal pour une paire créée à ~27  $\mu$ m de la face avant (distance équivalente au parcours d'un alpha de 5.5 MeV)



Temps de collection : électron : 10.8 ns trou : 1.8 ns

total : 10.8 ns <u>Remarque</u> : temps de montée nul !



Ρ

 $\mathbf{x}_0$ 

Ν

# Tout le long du parcours

- On « découpe » le parcours de l'ion en N tranches équivalentes
- Dans chaque tranche on calcule :
  - Le nombre de paires électron-trou créées : Np = $\Delta E/3.6$  (eV).
  - La mobilité de chaque porteur de charge :  $\mu_+$ et  $\mu_-$  (la mobilité dépend du champ électrique, mais aussi de l'orientation du cristal)
  - Le courant créé par le mouvement de chaque porteur de charge i, et i à partir du théorème de Ramo :
    - $i_{\pm} = qv_{\pm}/d$



On somme les contributions

# Le signal sur toute la trace

- Exemple : alpha de 5.5 MeV dans le silicium (en face avant)
- Parcours : ~27 μm (SRIM)



# Et en face arrière?



Rmq : temps de collection = 32 ns



ρ =10 kΩ.cm e=300 μm Vpol=64V=2xVdepl

### Si on compare...



L.Lavergne - Du détecteur à la mesure - Roscoff 2007

# Les ions légers

- Bon accord avec les simulations
- La densité d'ionisation est relativement faible
- Exemple :
  - un deuton de 5 MeV
  - parcours de 137 μm
  - n ~ 10 000 e/μm



# Les ions lourds

- On ne peut pas utiliser le même formalisme pour les ions lourds
- Le signal est beaucoup plus long, l'amplitude plus faible
- Les modèles progressent



# Ions lourds : l'effet « plasma »

 La densité de charges crées par l'ionisation est liée à l'ion incident : plus l'ion est lourd, plus la densité est grande -> plasma

•Le temps de « plasma » : temps d'érosion du plasma, il dépend du champ électrique et de l'ion incident

• La quantité de charge mesurée peut se révéler inférieure à celle attendue (défaut d'ionisation ou PHD « pulse height defect »)

# Ions lourds : l'effet « plasma »



migration (pour les ions légers) plasma (écrantage du champ électrique) recombinaison des charges (E mesurée < E incidente)

La trace de l'ion dans le silicium est considérée comme un cylindre de rayon ~1  $\mu$ m et de longueur le parcours de l'ion (simulations)



# Un des derniers formalismes

- Les porteurs dans le « plasma » -> dipôles dans un milieu diélectrique.
- Ils induisent un champ électrique qui s'oppose au champ extérieur : le milieu se polarise
- La constante diélectrique dans la trace augmente  $\epsilon'{=}\epsilon{+}cste$  , le champ diminue par rapport à sa valeur initiale
- le champ finit par se restaurer
- Plus la densité de porteurs est grande, plus ils mettront du temps à se dissocier
  - les temps de collection sont plus longs.



Parcours ~180 μm n~10<sup>6</sup> e/μm

M.Parlog, thèse H.Hamrita



# La variation du champ électrique



#### Thèse H.Hamrita



# Les photons

• La géométrie et le champ électrique sont plus complexes





# La collection des charges (cas général)

- Vk électrodes
- Théorème de Shockley-Ramo :  $i_k(t) = -q\vec{v}.\vec{E}_k(\vec{d}(t))$
- Calcul du potentiel et du champ de pondération (*weighting potential* et *weighting field*) : artifice de calcul -> E<sub>k</sub> : rend compte du couplage géométrique entre la charge à une position donnée d et l'électrode k



Z.He, NIM A 463 (2001) 250-267

 potentiel 1 sur l'électrode de lecture et 0 sur toutes les autres, en l'absence de charge.

### Les détecteurs Si à pistes



Fig. 17. Electric potential in an elementary cell of a SSD. The values of the geometrical parameters are:  $d = 400 \,\mu\text{m}$ ,  $p = 228 \,\mu\text{m}$ ,  $w = 60 \,\mu\text{m}$ ,  $h = 5 \,\mu\text{m}$ .

Fig. 18. Drift line in a silicon cell. The geometrical parameters are  $d = 400 \,\mu\text{m}$ ,  $p = 228 \,\mu\text{m}$ ,  $w = 60 \,\mu\text{m}$ ,  $h = 5 \,\mu\text{m}$ . The bias potential is  $\phi_0 = 100 \,\text{V}$ .

Fig. 19. Weighting potential of a strip. The cell used for computing the potential includes four neighbour strips. The geometrical parameters are  $d = 400 \,\mu\text{m}$ ,  $p = 228 \,\mu\text{m}$ ,  $w = 60 \,\mu\text{m}$ ,  $h = 5 \,\mu\text{m}$ .

#### Exemple de potentiel, électrique, lignes de champ et weighting potential

NIMA 533 (2004) 322-343

# Les détecteurs Ge planaires à pistes

- Notion de charge miroir, induite sur les pistes voisines
- Phénomène transitoire
- Utilisé pour la localisation sur les segments



NIM A 525 (2004) 188-192

### Les détecteurs Ge segmentés



L.Lavergne - Du détecteur à la mesure - Roscoff 2007

### Pour résumer

Les notions importantes dans la formation du signal



# Le champ électrique en général

- Important pour les simulations à 1, 2, 3D
- Utilisé pour calculer les temps de collections et les signaux de courant et de charge (Si et Ge)
- Utilise le formalisme électrostatique avec des logiciels dédiés ou développés (MATLAB, COMSOL MULTIPHYSIC (FEMLAB), MAXWELL, MGS, PS2D....)



# Les autres paramètres

· la géométrie, la segmentation, les temps de collection,....



AGATA, simulation des temps de collections



Nouvelle géométrie : correction des effets d'anisotropie et de temps de collection (Ripamonti et al., 2005)

## La mesure en énergie

- Electronique
- Résolution en énergie



### **Overview of readout electronics**

C.de la Taille Bénodet 2006



# Le préamplificateur de charge



Le détecteur -> capacité et source de courant -> source de bruit

# La résolution en énergie

- En général la distribution est gaussienne
- Elle s'exprime par la largeur à mi-hauteur (LMH) de la distribution ou FWHM (Full width at half maximum) : LMH = 2.35  $\sigma$
- Exemple :

Spectre du 238Pu (5.155 MeV) dans un détecteur silicium (50 mm², 500 µm, -15°C)

LMH=7.8 keV

∆E/E = 0.15%





# La distribution en énergie

- Élargissement dû à des fluctuations :
  - Statistique de création de paires : N = E/ $\omega$ ,  $\sigma$ = (F.N)<sup>1/2</sup> LMH = 2.35(F.E. $\omega$ )<sup>1/2</sup> avec F = facteur de Fano ~0.1
    - Pour le Si : LMH (keV)=  $1.4 \int E(MeV)$
    - Pour le Ge : LMH (keV) =  $1.3 \int E(MeV)$
  - Pertes d'énergie dans la source de calibration, effets nucléaires, fenêtres d'entrée et de sortie, effets de canalisation, straggling en énergie, défaut d'ionisation (ions), matière, effet Döppler,... (γ)
  - Bruit électronique : LMH évaluée en fonction du filtre et des bruits série et parallèle (via un générateur d'impulsions)
    - Courant
    - Résistance
    - Capacité...
- Résolution intrinsèque : LMH<sup>2</sup><sub>dét</sub>= LMH<sup>2</sup><sub>totale</sub>- LMH<sup>2</sup><sub>bruit</sub>

# La calibration

Quelques sources étalons (les principales): kev/canal

- Alpha de quelques MeV :
  - <sup>239</sup>Pu (5.155 MeV), <sup>241</sup>Am (5.486 MeV), <sup>244</sup>Cm (5.806 MeV)
- Électrons de conversion :
  - <sup>207</sup>Bi : 975 keV
- X:
  - <sup>55</sup>Fe : 5.9 keV
  - <sup>241</sup>Am : 56 keV
- Gamma :
  - 60Co : 1.332 MeV
  - <sup>57</sup>Co : 122 keV
  - <sup>137</sup>Cs : 662 keV





### La caractérisation des détecteurs Si

- Si et Si(Li) à température ambiante
- En général : i, V, C, LMH ( $\alpha$  de 5.5 MeV, <sup>241</sup>Am et électrons du <sup>208</sup>Bi)

Spectre  $\alpha$ : <sup>238</sup>Pu, <sup>241</sup>Am, <sup>244</sup>Cm, (5.155, 5.486, 5.805 MeV) LMH=15 keV, Si 200 mm<sup>2</sup>, 300  $\mu$ m i = 90nA Vpol = 170 V



# La caractérisation des détecteurs Ge

- Efficacité relative à 1.33 MeV , liée au volume du détecteur (23g de Ge -> ~1% efficacité relative)
  - $\epsilon$ (NaI) = 1.2 10<sup>-3</sup>
  - $\varepsilon_{rel} = \varepsilon(Ge)/\varepsilon(NaI)$
- Résolution en énergie

```
Spectre <sup>60</sup>Co (1173 et 1332 keV),
LMH (1.332 MeV) = 1.9 keV
Détecteur Ge, type N, 20%
-3000 V
```

- Fournisseurs
  - Rapport P/C (pour <sup>60</sup>Co, entre 1040 et 1096 keV)
  - Forme de la distribution :
    - FW1/10M et FW1/50M par rapport à FWHM
    - Écart par rapport à une gaussienne





### La mesure en position

Généralement segmentation des électrodes :

- Localisation et mesure de l'énergie
  - Pistes (localisation x, y)
  - Segments (pixels, pads)
  - Secteurs  $(r, \theta)$
- Tracking  $\gamma$

# Détecteur à piste double face





# Détecteur à couches résistives

 Détecteurs à surface(s) résistive(s) -> barycentrage des signaux générés aux électrodes



résolution en énergie dégradée (bruit dû aux résistances de couche)

# L'identification des ions

- Méthode E- $\Delta$ E (montage en télescope)
- Temps de vol
- La forme du signal

# Méthode $E-\Delta E$ : identification (A,Z)



# Le temps de vol : identification en A



$$E = \frac{1}{2}Av^{2} = \frac{1}{2}A(\frac{d}{t})^{2}$$

$$t = d \sqrt{\frac{A}{2E}}$$

- Il faut
  - mesurer une différence de temps t (entre un start et un stop)
  - un détecteur qui arrête l'ion qui dépose son énergie E
  - une distance suffisamment adaptée d





# La forme du signal : identification (A,Z)?

- Numériser le signal de charge (Si et Ge) ou le signal de courant (Si)
- Construire une base de données
- Utiliser des algorithmes spécifiques (traitement du signal)
  - Energie vs temps de montée
  - Energie vs moment d'ordre 2
  - Moment d'ordre2 vs moment d'ordre 3
  - Réseau de neurones
  - Filtrage optimal....



<sup>80</sup>Kr-<sup>84</sup>Kr @680 MeV

L.Bardelli, FAZIA, 2007



- Formation du signal
- L'énergie et la position
- Les méthodes d'identification

